

行事案内

第 25 回プラズマエレクトロニクス講習会

～プラズマプロセスの基礎とその応用・制御技術～

主催: 応用物理学会 プラズマエレクトロニクス分科会

協賛: 日本物理学会、電気学会、プラズマ・核融合学会、日本化学会、電子情報通信学会、放電学会、日本真空学会、ドライプロセスシンポジウム(一部打診中)

日時: 2014 年 11 月 26 日(水) 9:30～18:00

場所: 東京工業大学 田町キャンパス 国際会議室

東京都港区芝浦 3-3-6

JR 田町駅徒歩 2 分、もしくは都営浅草線三田駅

http://www.titech.ac.jp/about/campus_maps/tamachi.html

内容／プログラム: プラズマプロセスは、エレクトロニクス分野では半導体デバイスやフラットパネルディスプレイの開発・製造を支える技術であると共に、医療やエネルギー・環境応用を始めとする幅広い分野でも欠くことのできない基盤技術となりつつあります。このような背景を踏まえ、本講習会では、産業応用で必要とされるプロセスプラズマの生成、診断・制御、モニタリング技術の基本と、その先端応用技術について各分野にて第一線でご活躍の先生方よりご講義頂きます。今年は、応用技術として大気圧プラズマによる成膜および環境クリーン化技術、半導体製造における極微細エッチングおよびその制御技術にフォーカスしました。初学者から先端の研究開発者まで幅広い皆様のご参加をお待ち申し上げます。

■ 第1部: プラズマプロセスの基礎 9:30～12:30 ■

1. 『プラズマプロセスの基礎と素過程』

大阪大学 浜口 智志 先生

2. 『プラズマ計測と診断』

北海道大学 佐々木 浩一 先生

■ 第2部: プラズマ技術の最前線 13:50～18:00 ■

3. 『大気圧プラズマ技術と成膜応用』

大阪大学 垣内 弘章 先生

4. 『プラズマを用いた環境クリーン化技術』

豊橋技科大 水野 彰 先生

5. 『半導体ドライエッチング技術』

名古屋大学 関根 誠 先生

6. 『統計解析を用いた半導体プロセス制御技術』

(株)日立製作所 田中 潤一 先生

※ 講義題目は、一部仮題です。

参加費: (テキスト代を含む。かつこ内は学生)

- | | |
|------------------|-----------------|
| ● 応物・PE 分科会個人会員 | 18000 円(4000 円) |
| ● 応物個人会員 ※ | 21000 円(5000 円) |
| ● 分科会のみ個人会員 | 22000 円(6000 円) |
| ● 協賛学協会・応物法人賛助会員 | 22000 円(6000 円) |
| ● その他 | 25000 円(9000 円) |

※参加申込時に PE 分科会(年会費 3,000 円)に御入会頂ければ、分科会個人会員扱いとさせていただきます。

定員: 99 名

お申込み: プラズマエレクトロニクス分科会ホームページ

<http://annex.jsap.or.jp/plasma/> より

お申し込みの上、下記指定口座へ振込み願います。

(申し込み専用 web ページは 8 月中旬開設予定)

三井住友銀行 本店営業部 普通預金 3339808

(公社) 応用物理学会 プラズマエレクトロニクス分科会

※Web 申し込み期限は、11 月上旬の予定です。

お問合せ:

小田 康代 (応物事務局) ... 申し込み手続き関連

TEL 03-5802-0863 FAX 03-5802-6250

e-mail: oda@jsap.or.jp

伊澤 勝 (日立ハイテク、担当幹事代表) ... 開催内容関連

e-mail: izawa-masaru@sme.hitachi-hitec.com

・担当幹事

大村 光広 (東芝)、久保井 信行 (ソニー)、小林 浩之 (日立)、伝宝 一樹 (TEL)、松隈 正明 (TEL)、和田 昇 (三菱)